PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-133491

(43) Date of publication of application: 18.05.2001

(51)Int.CI.

G01R 27/04 G01R 1/06 G01R 31/02 G01R 31/28 H05K 3/00

(21)Application number: 2000-092580

(71)Applicant: ONISHI DENSHI KK

(22)Date of filing:

30.03.2000

(72)Inventor: KONISHI HIDEO

KAWASAKI AKIRA

(30)Priority

Priority number: 11235557

Priority date: 23.08.1999

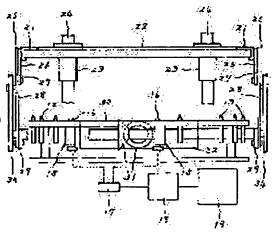
Priority country: JP

(54) PROBING DEVICE FOR MEASURING IMPEDANCE OF PRINTED-CIRCUIT BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently measure impedance by making constant the contact state of a probe pin for the measurement point of the test pattern of a printed—circuit board.

SOLUTION: A printed-circuit board 36 is pressed to an area to a substrate pressurization stand 11 via a clamp press mechanism 25 and a substrate pressurization board 20 for intimately bringing each measurement point 38 of the printed-circuit board 36 into contact with each probe pin 16 is provided on the substrate pressurization stand 11 for mounting a high-frequency probe unit 15 with a plurality of probe pins 16 that can come into contact with a circumscription pin 12 for positioning the printed-circuit board 36 for supporting, a guide pin 13, and each measurement point 38 of the printed-circuit board 36. The probe pin 16 of a high-frequency probe unit 15 is selectively connected to the measurement part of a measuring instrument body 19 via a probe pin selection switch 18.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-133491 (P2001-133491A)

(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

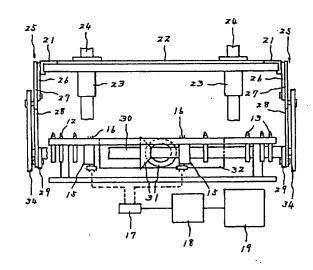
(51) Int.Cl.7	餓別配号	FΙ	テーマコード(参考)
G01R 27/04		G01R 27/04	2G011
1/06		1/06	E 2G014
31/02		31/02	2G028
31/28		H 0 5 K 3/00	T 2G032
H05K 3/00	•	G01R 31/28	ĸ
		審査請求 未請求	請求項の数2 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特願2000-92580(P2000-92580)	(71)出願人 591124123	
		大西電	子株式会社
(22)出顧日	平成12年3月30日(2000.3.30)	滋賀県道	丘江八幡市若宮町226番地の8
		(72)発明者 小西 多	英雄
(31)優先権主張番号	特願平11-235557	滋賀県近江八幡市若宮町226番地の8	
(32)優先日	平成11年8月23日(1999.8.23)	西電子	朱式会社内
(33) 優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 河崎 3	乾
		滋賀県	近江八幡市若宮町226番地の8 大
		西電子	朱式会社内
		(74)代理人 1000719	995
		弁理士	井上 英朗
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プリント基板のインピーダンス測定用プロービング装置

(57)【要約】

【課題】 プリント基板のテストバターンの測定ポイントに対するプローブピンの接触状態を一定にして、インピーダンスの測定を効率的に行う。

【解決手段】 プリント基板36を位置決めして支持する外接ピン12とガイドガイドピン13及びプリント基板36の各測定ポイント38に接触可能な複数のプロープピン16を有する高周波プローブユニット15を取り付けた基板加圧台11上に、クランクプレス機構25を介して基板加圧台11との間にプリント基板36を加圧して、プリント基板36の各測定ポイント38を各プローブピン16に緊密に接触させる基板加圧盤20を設ける。高周波プローブユニット15のプローブピン16は、プローブピン切換スイッチ18を介して、測定器本体19の測定部に選択的に接続する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のばね外方付勢式基板位置決め・支持ピン及びプリント基板の複数の測定ポイントに接触可能なばね外方付勢式の複数のプローブピンを有する高周波プローブユニットを取り付けた帯電防止性の基板加圧台と、基板加圧台に接近離隔可能に設置するとともに最接近時にプリント基板を加圧して各測定ポイントを各プローブピンに緊密に接触可能な絶縁性の基板加圧盤を備えてなるプロービング装置。

【請求項2】 高周波プローブユニットの複数のプローブピンは、プローブピン切換スイッチを介して、選択的 にインピーダンスの測定に供することが可能である、請求項1記載のプロービング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、特にプリント基板(配線板)に設けるテストバターン(テストクーポン)部のインピーダンスをタイム・ドメイン・リフレクトメトリ(TDR)方式で測定するために、複数(二つ以上)のプローブピン(プローブの先端部)をテストバ 20ターン部の複数の測定ポイント(一般には一組以上すなわち一対以上のグランド端子と信号端子、換言すればそれぞれ一つ以上のグランド端子と信号端子)に接触(当接)させるプロービング装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来においては、この種のプロービングは、ハンディ型の髙周波プローブユニットによる手操作で行われている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかるにこのような手 30 操作のプロービング方式には、各プローブピンの各測定ポイントに対する接触状態が一定にならず、測定精度を上げるためには、一組(一対)の測定ポイント(グランド端子と信号端子)について数回以上の測定を行い、それらの平均値を測定値として採用するという形態を取らざるを得ない状況にあり、特に多層のプリント基板のように、測定ポイント数、換言すれば測定組数(グランド端子と信号端子の組合せ数)が多い場合には多大の時間がかかるという問題がある。

【0004】 この発明は、上記のような問題に鑑み、プ 40 ローブピンの測定ポイントに対する接触状態を一定にして、インピーダンスの測定を効率的に行うことを主要な課題としている。

[0005]

近離隔可能に設置するとともに最接近時にプリント基板 を加圧して各測定ポイントを各プローブピンに緊密に接触可能な絶縁性の基板加圧盤を備えてなるプロービング 装置によって解決する。

【0006】基板位置決め・支持ピンとしては、基板外接型、基板ガイド穴係合型(ガイド穴は貫通形、不貫通形の両者を含む)の一方あるいは両者を用いることができる。

そでなるプロービング装置。 【0007】基板加圧盤の基板加圧台に対する接近離陽 【請求項2】 高周波プローブユニットの複数のプロー 10 及びプリント基板の加圧は、クランクやリンク仕掛け等 プビンは、プローブビン切換スイッチを介して、選択的 を含む適宜のプレス機構を介して行うことができる。

> 【0008】基板加圧盤の絶縁性は、特に表面部を熱可 塑性ポリエステル系コンポジットで形成するという形で 実施すると、静電防止の点で好適である。

> 【0009】との発明に係るプロービング装置は、一般 には、インピーダンスを測定すべきプリント基板を、基 板加圧台上に、髙周波プローブユニットの複数のプロー ブビン(一般にはプリント基板に形成の一つ以上のグラ ンド端子と一つ以上の信号端子のそれぞれに対応する一 つ以上のグランド端子接触用と一つ以上の信号端子接触 用)のそれぞれが、テストクーポン部の複数の測定ポイ ントのそれぞれに隣接する状態に、複数の位置決め・支 持ピンを介して位置決めして支持した後、基板加圧盤を 基板支持台に接近させることにより、各位置決め・支持 ピン及び各プローブピンをぱねに抗して収縮(後退)さ せながら、プリント基板を加圧して、各プローブピンを 対向する各測定ポイントに緊密に接触させて、所望の測 定ポイント (グランド端子と信号端子)間の回路のイン ピーダンスを、該測定ポイントに対向するプローブピン (グランド端子接触用プローブピンと信号端子接触用プ ローブピン)の測定器本体(測定部)に対する接続のも とで測定可能にする一方、測定の終了後は、基板加圧盤 を基板加圧台から離隔し、これにより各位置決め・支持 ピン(及び各プローブピン)をばねの付勢力により伸長 (前進) させて、プリント基板を基板加圧台上から浮き 上がらせた後、測定済みのプリント基板を基板加圧台上 から台外に取り去るという形で用いる。

> 【0010】プリント基板の測定ポイントが二つだけ、すなわちグランド端子と信号端子が1個ずつの場合には、これに対向する二つのプローブピンの測定器本体に対する接続状態で、両端子間の回路のインピーダンスを測定可能であるが、多層のブリント基板の場合のように、プリント基板の測定ポイントが三つ以上(グランド端子と信号端子の少なくと一方が二つ以上)で、これに対応してプローブユニットのプローブピンが三本以上のように測定ポイント数(測定組合せ数)が二以上の場合においては、インピーダンスを測定すべきプリント基板におけるグランド端子と信号端子の測定ポイントを切換える関係上、プローブユニットにおけるグランド端子接触用のブローブピンの測定器本体に対

する接続を切換えるプローブピン切換スイッチを設け る。すなわちプローブユニットにおける複数のプローブ ピンは、プローブピン切換スイッチを介して、選択的に インピーダンスの測定に供することができるようにす る。

[0011]

【発明の実施の形態】以下図面に基づいて、との発明に 係るプロービング装置の実施形態を説明する。

【0012】図示した実施形態においては、帯電防止材 料からなる基板加圧台 1 1 は方形で、各コーナー近傍部 10 ーブピン 1 6 の先端に隣接させた後、クランクプレス機 には、プリント基板36の各コーナー近傍部に外接する ばね外方付勢式の外接ピン12と、プリント基板36の コーナー部に形成のガイド穴37に係合するばね外方付 勢式のガイドビン13とからなる位置決め・支持ピン が、台上に直立してのびる状態で取り付けてあり、また それぞれプリント基板36の複数(図示例では五つ)の 測定ポイント38を含む左右二つのテストパターン部に 対応する正面側の側部近傍には、テストパターンとの容 量結合防止空間としての左右にのびる溝14の両端部 に、ブリント基板36の左右二つのテストバターン部に 20 対向する一対の高周波プローブユニット15が取り付け てある。

【0013】各髙周波プローブユニット15は、髙周波 帯域の特性を保持するために、実質部を真鍮板等製のケ ース内に内蔵した形態で、先端がそれぞれプリント基板 36のテストパターン部の複数の測定ポイント38に接 触可能に台上に突出する複数(ことでは五つ)のばね外 方付勢式のプローブピン 1 6 を備えており、各高周波プ ローブユニット15において各組を構成する対の(グラ ンド端子用と信号端子用の)プローブピン16は、SM 30 上述した形態に限定されるものではない。 A型のコネクタ (スルーコネクタ) 17を介して接続し た同軸リレー型の切換スイッチ18による切換操作によ って選択して、測定器本体19の測定部(図示せず)に 選択的に接続するように構成してある。

【0014】基板加圧盤20は、図示はしないがアルミ ニウム板などの表面部を熱可塑性ポリエステル系コンポ ジットシートで被覆した方形の絶縁盤で、左右の一対の 側枠21と両側枠21の後部間をのびかつ両端部にガイ ドブッシュ23を取り付けた後枠22とからなる盤枠に 3を装置枠の底壁33から垂直に立ち上がる縦ガイド軸 24 にスライド自在に嵌合することにより、基板加圧台 11の上方部を上下に移動可能に設置してあり、さらに 先端部を側枠21の中間部に枢着するとともに中間部を 揺動リンク27を介して装置枠の側壁34に枢支した屈 曲形レバーリンク26、エア式ロータリアクチュエータ 32から一対のベベルギア31を介して駆動するクラン ク軸(主軸)30及びクランクアーム29並びにレバー リンク26の後端部とクランクアーム29の先端部の間 を連結する連結アーム28を含む左右一対のクランクプ 50 【図3】図1~図2に示す実施形態の基板加圧台の平面

レス機構25を介して上下に駆動するようになってい る。

【0015】との実施形態は、プリント基板36を左右 の両テストバターン部の各測定ポイント38部が左右の 各高周波プロープユニット15の各プローブピン16に 対向するように、位置決めピン(外接ピン12、ガイド ピン13)による位置決めを介して、基板加圧台11上 に支持し、これによりプリント基板36の各測定ポイン ト38を高周波プローブユニット15の対応する各プロ 構25を介して基板加圧盤20を下降して、プリント基 板36を基板加圧台11上に加圧する。これによりプリ ント基板36の左右のテストクーポン部の各測定ポイン ト38は、対応する髙周波プローブユニット15におけ る各プローブピン16に緊密に接触する。

【0016】この状態で切換スイッチ18により、プリ ント基板36のインピーダンスを測定しようとする左又 は右の一方のテストクーポン部に対向する左又は右の高 周波プローブユニット15における対のプローブピン1 6を順次選択して、各対のプローブピン16に対向する プリント基板36における対の測定ポイント38間の回 路のインピーダンスの測定を行う。

【0017】とのようにして一方のテストクーポン部に おけるインピーダンスの測定が完了したら、他方のテス トクーポン部についても、同じように切換スイッチ18 の切換操作を挟みながら、順次複数の測定ポイント38 対間の回路のインピーダンスの測定を行う。

【0018】との発明のプロービング装置は、とのほ か、種々の形態で実施することができるもので、図示や

[0019]

【発明の効果】との発明のプロービング装置によれば、 プリント基板を基板加圧台上に、高周波プローブユニッ トに対して位置決めして支持した状態で、基板加圧盤を 介してプリント基板を加圧して、プリント基板のテスト バターン部の測定ポイントを対応するプローブピンに緊 密に接触させるので、プローブピンのプリント基板の測 定ポイントに対する接触状態は常に一定になり、インビ ーダンス測定を髙効率で行うことができる。

保持してある一方、後枠22に付設のガイドブッシュ2 40 【0020】またとの装置においては、髙周波プローブ ユニットにおける複数のプローブピンを、プローブピン 切換スイッチを介して測定器本体に選択的に接続して、 インピーダンスを測定可能にするので、複数部位のイン ピーダンスの測定も、プローブピン切換スイッチの切換 操作のみで進めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明に係るプロービング装置の実施形態の 要部正面図である。

- 【図2】図1に示す実施形態の要部の側面図である。

図である。

【図4】図1~図3に示す実施形態におけるプリント基板の基板加圧盤による加圧前の状態を示す部分拡大図である。

【図5】図1~図3に示す実施形態におけるプリント基板の基板加圧盤による加圧時の状態を示す部分拡大図である。

【符号の説明】

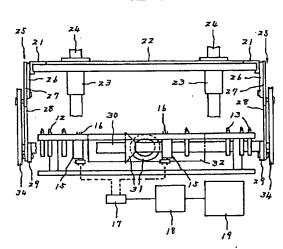
- 11 基板加圧台
- 12 外接ピン
- 13 ガイドビン
- 14 溝
- 15 髙周波プローブユニット
- 16 ブローブピン
- 17 コネクタ
- 18 プローブピン切換スイッチ
- 19 測定器本体
- 20 基板加圧盤

*21 側枠

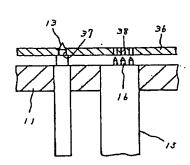
- 22 後枠
- 23 ガイドブッシュ
- 24 縦ガイド軸
- 25 クランクプレス機構
- 26 屈曲形レバーリンク
- 27 揺動リンク
- 28 連結リンク
- 29 クランクアーム
- 10 30 クランク軸
 - 31 ベベルギア
 - 32 エア式ロータリアクチュエータ
 - 33 装置枠の底壁
 - 34 装置枠の側壁
 - 36 プリント基板
 - 37 ガイド穴
 - 38 測定ポイント

*

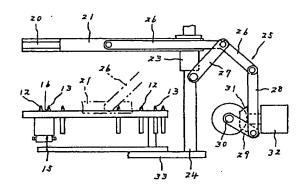
【図1】



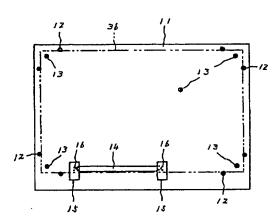
【図4】



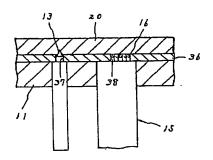
【図2】



【図3】



【図5】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2G011 AA02 AA12 AB01 AC06 AC14 AC32 AE01 AF07 2G014 AA02 AA03 AB59 AC10 AC12 2G028 AA04 BB00 BC01 CG08 2G032 AD03 AF02 AF04 AK04 AL03